薄膜の応用解析、表面解析、界面解析

有機エレ材研(JOEM)

【フォトポリマー懇話会との共催】

《日 時》 2015年 12月 11日(金)13時30分~16時30分

《会場》東京理科大学森戸記念館

(Web site: http://www.tus.ac.jp/facility/morito/ 地図参照) (所在地: 新宿区神楽坂 4-2-2 TEL: 03-5225-1033)

《プログラム》

座長 ソニー 市村 眞理、旭化成 小川 周一郎

13:30-14:20 「光 CEL IV 法によるトラップ密度測定とその応用」

兵庫県立大学 田島 裕之

14:20-15:10 「低エネルギー逆光電子分光法による 有機半導体の空準位と電子親和力の直接観測」

千葉大学 吉田 弘幸

15:25-16:15 「Ar ガスクラスター (Ar-GCIB) を用いた 有機デバイスの深さ方向 XPS、TOF-SIMS 分析」

アルバック・ファイ株式会社 眞田 則明

16:15-16:30 総括討論

参加費:参加費、講演要旨集代は無料です。

会員以外は参加費として 3,000 円 (学生 2,000 円) を当日受付にて申し受けます。

懇親会費:今回の懇親会はありません。

参加登録:参加登録,登録の変更は、12月4日(金)までに、次へお願いします。

- (1) Web site: http://www.organic-electronics.or.jp/ 経由『参加登録』画面
- (2) F A X: 0268-21-5413 (参加証は発行しません)
 - ※ 締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合が ございますのでご注意ください.

